# 超高輝度微小焦点X線回折装置と2次元検出器による 微小部X線回折測定

-SmartLab µHR & HyPix-3000-

白又 勇士\*

## 1. はじめに

X線回折法は、物質の結晶構造を評価する分析手法 で、試料にX線を照射しながらX線源や検出器、試料 を動作させることで角度情報( $2\theta$ )とX線強度情報(I) を得る.特に2 $\theta \leq 10^\circ$ 以下の領域を小角散乱(Small Angle X-ray Scattering, SAXS)領域、2 $\theta \geq 5^\circ$ 以上の領 域を広角散乱(Wide Angle X-ray Scattering)領域もし くは広角回折(Wide Angle X-ray Diffraction, WAXD) 領域と呼ぶ.また、X線回折法は、様々な物性の評価 が可能であり、定性分析(結晶相同定)・定量分析・ 結晶構造解析・配向分析・粒径解析等に幅広く応用さ れる.

通常,粉末X線回折法では,試料に対して約10mm× 数mm程度の幅広いエリアにX線を照射し、測定を行 う.一方、微小な試料や、岩石などの局所的な一部分 の分析を行う場合には、X線の照射野を0.01 mm~ 1mm程度に絞る必要がある.このような測定を行う 場合、従来は入射光学系において、スリットを用いて ビームの形を小さく成型するスリットコリメーション 方式を用いていたため、X線強度が低く、そのため長 時間の測定が必要であった.しかし、最近のX線回折 装置では、X線源、光学素子、検出器といった要素技 術の目覚ましい進化により、微小部測定であっても高 感度での測定が可能となってきている。そこで本稿で は、これら最先端要素技術が盛り込まれた最新の超高 輝度微小焦点X線回折装置SmartLab µHRに多次元検 出器HyPix-3000を搭載したシステムを用いることで 実現できた、様々な評価事例を紹介する.

## 2. SmartLab µHRの特長

## 2.1. 水平ゴニオメーター

SmartLab μHR は,汎用機 SmartLab のゴニオメー ターに微小焦点回転対陰極式X線管とCMF(Confocal

\*株式会社リガク X線機器事業部 応用技術センター

Max-Flux) ミラーを組み合わせた装置である (図1).

ゴニオメーターは、試料水平保持方式であるため、 粉末はもちろん、液体やバルク体でも試料の設置が簡 単であり、試料の脱落を気にすることなく簡単に測定 できる.また、アタッチメントを装着すれば、カメラ で試料の測定したい場所を指定してマッピング測定を 行うことや、温度や湿度などを変化させながら測定す る*in-situ*測定なども行うことが可能である.次項か ら、SmartLab *µ*HRを特長付ける各要素技術・要素部 品について詳しく説明する.

2.2. X線源およびCMFミラー

X線源としては,封入式管球と回転対陰極式管球が よく知られている.一般的に回転対陰極式管球は封入 式管球より投入電力量を大きく設定することが可能な ため,高強度を得ることができる.

X線焦点は取り出し方によって、ライン焦点とポイ ント焦点に分かれる(図2).一般的にライン焦点取 り出しの場合は、X線発生ターゲット上の焦点形状の 長手方向と直交する方向にX線を取り出す.この光学 系は、集中法や平行ビーム法などの測定に使用され る.ポイント焦点取り出しの場合は、焦点形状の長手 方向からX線を取り出し、X線源を見かけ上、ポイン ト焦点として利用する.よって、ポイント状のビーム を作り出す際にロスが少ないため、コリメーターを使



 $\boxtimes$  **1.** SmartLab  $\mu$ HR.

用するような微小部測定に適している.

SmartLab µHRのX線源には、ポイント焦点取り出 しの微小焦点回転対陰極式X線管RA-Micro7<sup>(1)</sup>が使用 され、最高出力800Wかつ焦点サイズが¢0.07 mmで 世界最高レベルの輝度18 kW/mm<sup>2</sup>を有する.このX線 源から出射された発散X線ビームは、図3に示したよ うに微小焦点光学素子CMFミラー<sup>(2)-(5)</sup>によって集 光・平行化され、発散角度は進行方向に直交する2方 向のどちらについても約0.05度に平行化された、 1.2 mm×1.2 mmのサイズのビームに成形される.さ らに後段にコリメーターやピンホールを搭載し、CMF ミラーと組み合わせて使用すれば、¢0.05 mm~1.2 mm のビームを簡単に作り出すことができる.





図3. SmartLab µHRの入射光学系の構成例.

これらX線源と光学素子の組み合わせにより,従来の装置と比較して格段に輝度が高く,かつ平行性のよいX線を得ることができる.

図4に $\phi$ 0.05 mmのコリメーターを使用し,SmartLab (ライン焦点),SmartLab $\mu$ HR(ポイント焦点)の装 置にて強度比較した結果を示す.投入電力量を同等に 設定したSmartLabでの測定結果に比べてSmartLab $\mu$ HR では,約100倍の強度が得られていることがわかる.

# 2.3. ハイブリッド型多次元ピクセル検出器 HyPix-3000

HyPix-3000 は約3000 mm<sup>2</sup>の広い有感検出面積を有 し、0,1,2次元モードで測定することができるハイブ リッド型多次元ピクセル検出器である<sup>(6),(7)</sup>.検出器が 位置分解能を有しているため2次元モードで測定する とデバイリングの形状を直接的に観測することができ る.そのため、試料の配向や粒の粗さ/細かさの度合 いを簡単に把握することができる.図5に状態の異な



図4. SmartLabとSmartLab µHRの強度比較.



図5. 状態が異なる試料のデバイリングの比較.

- (1) Quartz (粒径10 µm).
- (2) Quartz (粒径100 µm).
- (3) Al (圧延板).

る試料の測定例を示した. 十分に結晶粒が細かい場合 は、一様なデバイリングが得られているが(図5(1)), 結晶粒が粗い場合には、分散したスポットで構成された 不連続なデバイリングとして観測されている(図5(2)). また、配向した粒子で試料が構成されている場合に は、デバイリングは、その強度分布に偏りがある円弧 として観測されるようになる(図5(3)).

HyPix-3000は,

- ・低バックグラウンド
- ・データの高速読み出し
- ・測定モードの切り替えが可能(0,1,2次元)

等の多くの特長を持つ検出器である<sup>(6)</sup>. 今まで,2次 元検出器を用いた測定では,検出器を固定したまま測 定する露光測定が主流であった.しかし,HyPix-3000 は1次元モードの場合だけでなく、2次元モードでも TDI (Time Delay Integration) 測定<sup>(8)</sup> を行うことができ る.したがって、広範囲な2次元情報を収拾しなくて はならないような測定であっても、HyPix-3000では2 次元モードのTDI測定を行うことで信号強度を積算で き、短時間の測定で良質なデータの取得が可能となる.

この測定モードで20/0測定を行う場合,各測定角 度において常に試料表面とほぼ平行な格子面からの情 報を得ることができる(図6(1)).図6(2)に示した 露光(20)測定では,回折に寄与する格子面は20位 置によっては試料表面から大きく傾いた格子面を観測 することになるため,配向している試料の場合,ピー クが観測されない場合があるので注意が必要である.

図7に実例を示す. 試料はSi基板上のAu薄膜で,



図6. 20/0および20 (露光) 測定の概念図.



図7. Si 基板上のAu薄膜に対するTDI (20/0) 測定と露光 (20) 測定.

試料表面とAuの(111)格子面が平行に配向している. TDI(20/0)測定を行うと、入射角が連続的に変化す るが、20/0連動スキャンであるため、表面にほぼ平行 な回折面を観測することができ、Au111の回折ピーク が観測される(図7(1)).これに対し露光(20)測定 では、固定する入射角度によってはAu111の回折条件 を満たす格子面が存在しないため、回折ピークが観測 されないことがある(図7(2),(3)).このように、露 光測定を使って配向試料を測定する場合には、入射角 度によっては回折ピークが観測されない場合があるの で、注意する必要がある.

このようにHyPix-3000で2次元モードのTDI測定を 行うということは、多連装された検出器を使って個々 の検出器が強度積算しながら測定していることと同じ になるので、0次元検出器で測定するよりも、短時間 で測定することが可能となり、信号強度が弱いことが 多い微小部測定においてもまた威力を発揮する.2次 元モードでの測定では、通常、ポイント状のビームを 必要とするため、ポイント状かつ高強度なX線ビーム が得られる SmartLab µHRと HyPix-3000を組み合わせ たシステムは、最良の組み合わせであると言える.

### 3. 測定例

3.1. Au薄膜のマッピング測定を用いた配向性評価 通常のX線回折法のように、サイズの大きな入射X 線ビームを試料に照射すると、広い照射エリア内の平均 情報を得ることになる.一方、微小部光学系を用いれば、 試料の局所的な情報を得ることが可能である.本測定 では、Si基板上のAu薄膜試料に対して、 $\phi$ 0.05 mmの コリメーターを用いて、0.1 mmステップで1.7 mm× 1.7 mmの領域の289点についてマッピング測定を行い 配向性のばらつきを評価した.

測定は、1点あたり、5秒の露光時間で行った.なお、 マッピング測定の際には、測定ソフトウェアのSmart-Lab Guidanceと試料観察カメラを組み合わせて試料画 像を取り込み、測定部位を指定することも可能であ る.実測したAu111の2次元回折像の一例を図8に示 す.

このデータから,あおり( $\beta$ )方向の角度を変数と した強度変化のプロファイル( $\beta$ -*I*プロファイル;図



図8. Si基板上のAu薄膜の111反射の2次元回折像.

9)を作成し、各測定点の半値幅を算出した.その結果をマッピング表示した結果を図10に示す.

この結果から、試料は部位によって1.58~1.69°の 半値幅のばらつきを持ち、測定中央部で半値幅がやや 広くなっていることがわかった.よって、相対的に中 央部は配向性が低くなっていることがわかる.

0次元検出器を用いた配向性評価では、各点におい てロッキングカーブ測定(ωスキャン)を行うことで データ取得する.一方、高輝度X線源と多次元検出器 を組み合わせれば、信号の弱い微小部測定であって も、短時間の露光測定だけであおり方向の情報(ロッ キングカーブ)だけでなく、2θ方向の情報も同時に 取得できるため、短時間で多くの情報を得ることが可 能である.

3.2. 微小部測定を用いた岩石の定性分析

一般に、鉱物は天然に産出する決まった化学組成を 持つ結晶性無機物と定義される.また、岩石は鉱物の 集合体で、1つ1つの粒が小さい場合が多い.そのた め、岩石に含まれる微小な鉱物を測定するためには、 それぞれの部位のみを選択的に測定できる光学系が必 要になる.本測定では、 $\phi0.05 \text{ mm} のコリメーターを$ 用いて、図11のような天然の玄武岩の黒色部、白色 部を約40分で測定し、得られた2次元回折像から定性 分析(結晶相の同定)を行った.



図9. Si基板上のAu薄膜の111反射のβ-Iプロファイル.



図10. Si 基板上のAu 薄膜の111 反射の各測定点に対する半価幅 マッピング.



縦10 cm×横15 cm× 厚み 2 cm







2次元回折像を確認すると、まばらに点在するス ポットで構成された不連続なデバイリングが観測され ており、粒がかなり粗いことがわかった.そこで、回 折に寄与する結晶子の数を増やすために、φ軸(面内 回転軸)や|軸(あおり軸)を揺動しながら測定した(図 12(1),13(1)).

本測定においては、2.3.節で説明した2次元モード のTDI測定を行っており、HyPix-3000の広い有感検出 面積と試料の揺動の効果の結果、広範囲な2次元情報 を短時間で収集し、結晶相の同定に必要なデータを得 ることができた.その結果、白色部はMgに富むカン ラン石 (forsterite)、黒色部はMgに富む輝石 (enstatite) であることがわかった (図12(2)、13(2)).

図12(1)を見るとわかるが,白色部を形成するMg に富むカンラン石はかなり粒度が粗く,2次元回折像 には,点在するスポットで構成された不連続なデバイ スリングしか観測されていない.しかし,広範囲な2 次元情報から求められた1次元プロファイル(図12 (2))では,かなり多くの回折ピークが確認でき,主 要ピーク位置の検討から,構成物質はMgに富むカン



図13. (1) 揺動して測定した黒色部の2次元回折像.(2) 黒色部の定性分析結果.

ラン石であることを特定できた.

また,黒色部は白色部と比較すると、1次元プロファイルが粉末回折パターンに近づいており、かつ2次元回折像がデバイリングに近づいている.そのため 黒色部はX線照射領域内に、より多くの結晶粒が存在 していることを反映していると考えられる.

このように測定微小部位が多結晶でなく、単結晶粒 子や個体数の少ない結晶粒で構成されている場合で あっても、SmartLab µHR+HyPix-3000のシステムを 使用することで測定・解析が可能となることが期待さ れる<sup>(6)</sup>.

## **3.3. 2D-WAXS, 2D-SAXS**を用いたポリプロピレン の配向組織の解析

ポリプロピレンは、プロピレンを重合させた熱可塑 性樹脂で、包装材料や容器等に幅広く利用されてい る.また、加熱加工のプロセスの違いが配向性や高次 構造組織の変化をもたらし、結果として、材料物性に 影響してくる可能性がある.

そのため、有機高分子材料やそのコンポジット系材 料の評価においては、WAXSを用いた分子構造の配向



- 図14. 1・2 軸延伸ポリプロピレンフィルムの2D-WAXS 測定結果. (1) 1 軸延伸フィルム.
  - (2) 2軸延伸フィルム.



X線入射方向

図15. 試料の延伸処理の方向と入射X線との配置.



図16. ポリプロピレンフィルム110反射のβ-Iプロファイル.

組織の解析とSAXSによる高次構造組成や長周期構造 の解析,という2種類の測定から材料評価を行う必要 がある.さらに、有機材料の特長から透過法での測定 が有効である.SmartLab  $\mu$ HRでは、HyPix-3000の大 きな有感面積を活かした透過2D-WAXS,2D-SAXSの 測定が可能であり、このニーズに対応することができ る.カメラ長を27 mmにすることで、露光測定で2 $\theta$ = 7.0°~55.5°の範囲を測定でき、2D-WAXSの測定が可能 である.また、カメラ長を300 mmにすることで、2 $\theta$ = 0.2°~7.0°までの2D-SAXSの測定が可能である.

本節では、2種類のポリプロピレンの評価事例を紹 介する.

まず、1軸および2軸延伸処理が施されたポリプロ ピレンフィルム(約20 mm×20 mm×0.1 mm)に対し



露光時間:60分

露光時間:90分

図17. ポリプロピレン平板の2D-SAXS測定結果.
(1) ポリプロピレン平板.
(2) ポリプロピレン平板 (プレス成形).



図18. ポリプロピレン平板の長周期ピークに対するβ-Iプロ ファイル.



図19. ポリプロピレン平板の2*0*-Iプロファイル.

て、カメラ長を27 mmに設定し2D-WAXS測定を露光 時間3分で測定した2次元回折像を図14に示す.また、 試料の延伸処理の方向と入射X線との配置の関係図を 図15に示す.

1軸延伸したフィルムの2次元回折像を図14(1) に示 した. 110,040,130などの反射がTD方向に偏って観測 されていることがわかる.一方,2軸延伸したフィルム の2次元回折像(図14(2))では、110の反射がMD,TD 方向の4箇所の極大として観測されており、1軸延伸の 試料とは配向組織が異なっていることが簡単にわかる. それぞれのポリプロピレンフィルムの110反射のβ方 向の強度分布から、ピークの半値幅を求めることによ り、配向性を評価することができる(図16).

次に、プレス成形を行ったポリプロピレン平板(約 20 mm×20 mm×2 mm)に対して、カメラ長300 mm に設定した2D-SAXS測定を露光時間60,90分で測定 した2次元回折像を図17に示す.

図17(2) に示した、プレス成形のポリプロピレン 平板の2次元回折像では、強度の一様なデバイリング が観測されているのに対し、図17(1)のプレス成形 処理のないポリプロピレン平板の2次元回折像では、 デバイリングの強度は一定ではなく、二箇所に極大が 観測されている.この2次元回折像の比較から、両試 料間には、表面の面内方向の長周期構造の配向性に明 瞭な違いがあることが確認できる.また、2次元回折 像からそれぞれの試料の長周期ピークに対してβ方向 の強度分布プロファイルを切り出し、長周期構造の面 内方向の配向性の程度を定量的に評価することも可能 である(図18).

さらに、図19のように、2次元回折像から20プロファイルを切り出し、ピークの位置から長周期構造の 周期長のd値を求めることができ、ピークの半値幅を 算出すれば長周期構造のd値のばらつきがわかり、試 料間の比較も可能である.本試料においては、プレス 成形した試料の方が半値幅が狭く、d値のバラつきが 少ないと考えられる.

## 4. 終わりに

SmartLab µHRとHyPix-3000は非常に相性の良いシ ステムであると同時に、「高輝度X線源」、「CMFミ ラー」(入射X線ビームの質の良さ),「使い勝手の良 いゴニオメータシステム」(試料水平保持,ソフトウェ アなど),「多次元検出器HyPix-3000」といった最先端 要素技術や要素部品が採用されている.これらの特長 をうまく活かせば,従来は放射光施設でしか実現でき なかったような様々な測定や,従来装置では実現が困 難であったような複雑な評価方法を実現できる可能性 がある<sup>(9)</sup>.このシステムを用いることで,材料評価に 要する時間が格段に短縮され,また,新しい材料開発 の可能性が大きく広がってゆくことが期待される.

### 参考文献

- (1) 理学電機ジャーナル, 33 & 34 (2003), 36-41.
- (2) L. Jiang, Z. Al-Mosheky, and N. Grupid: *Powder Diffr*., 17 (2002), 81–93.
- (3) 原田仁平:日本結晶学会誌, 45 (2003), 306-313.
- (4) 清水一明, 表和彦: リガクジャーナル, 39 (2008), No. 1, 1–9.
- (5) 伊藤義泰:リガクジャーナル, **39** (2008), No. 1, 10–16.
- (6) リガクジャーナル, 45 (2008), No. 1, 26-28.
- (7) P. Maj, R. Szczygieł, P. Gryboś, T. Taguchi and Y. Nakaye: *J. Instrum.*, **10** (2015), C02006.
- (8)小林信太郎,稲葉克彦:リガクジャーナル,42 (2011),No.1,9-14.
- (9) P. Zaumseil: J. Appl. Cryst., 48 (2015), 528–532.